

PDP向けカセット洗浄装置

<概要>

本装置はPDP用基板を搬送するカセットを温水高圧シャワー⇒液切り⇒温風乾燥させる自動洗浄装置です。
カセットに合わせ設計・製作致します。

<主な仕様>

1. 被加熱物 : PDPカセット (2800W×4700D×1500H) 重量 : 1000kg
2. 処理方法 : 純水高圧洗浄+温風乾燥
3. 処理速度 : 100mm/s (Tact Time : 28min)
4. 加熱条件 : 100℃±5℃
5. パスライン : FL+2400

<実績(その他)>

FPD : G3、G6、G8 ガラス基板用カセット

<外観図(イメージ)と写真>

(8500 W×14500 D×4300 H)

